

⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 199 06 681 A 1**

⑳ Aktenzeichen: 199 06 681.7
㉑ Anmeldetag: 18. 2. 1999
㉒ Offenlegungstag: 14. 9. 2000

㉓ Int. Cl. 7:
G 01 B 11/16
G 01 B 11/24
G 01 N 21/45
G 01 M 11/08

15

I D S

DE 199 06 681 A 1

㉔ Anmelder:
Mähner, Bernward, 83607 Holzkirchen, DE

㉕ Vertreter:
Rüger und Kollegen, 73728 Esslingen

㉖ Erfinder:
gleich Anmelder

㉗ Entgegenhaltungen:

DE 196 39 213 A1
DE 195 01 073 A1
DE 40 13 309 A1

Nachdruck aus Applied Optics, Vol. 24, 1985,
S. 2172-2180 hier Seitennumerierung
563-571;

Wolfgang Osten, Digitale Verarbeitung und
Auswertung von Interferentbildern, Akademie
Verlag GmbH, Berlin, 1991, S. 124-146;

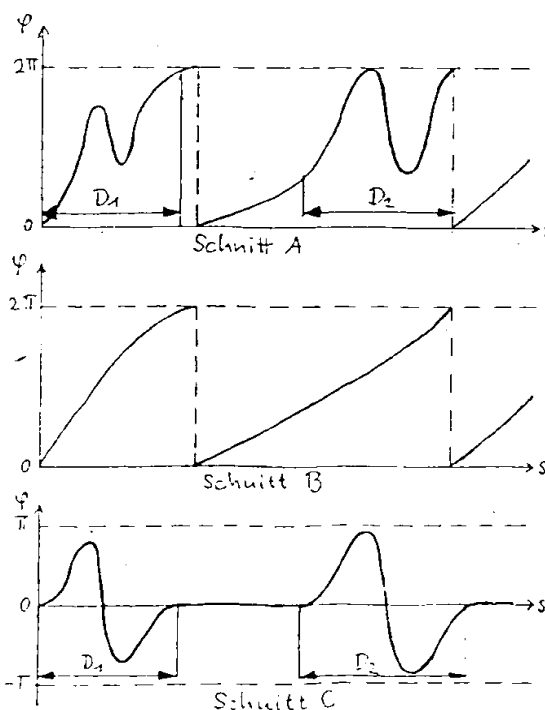
Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

㉘ Verfahren zur Ermittlung von Strukturmerkmalen an Prüfobjekten mit diffus streuender Oberfläche

㉙ Bei flächenhaft arbeitenden, optischen Verfahren zur Bauteilprüfung werden interferometrische oder mit strukturiertem Licht arbeitende Verfahren verwendet, die die Verformung des Objektes mittels Bildverarbeitung berechnen und das Ergebnis als Phasendifferenzbild darstellen. Den strukturabhängigen lokalen Verformungen des Objektes sind dabei häufig Ganzkörperbewegungen oder sonstige nicht relevante globale Objektverformungen überlagert, die das Erkennen von lokalen Strukturmerkmalen, insbesondere Strukturdefekten, erschweren. Bei dem neuen Bildverarbeitungsverfahren wird das Phasendifferenzbild so manipuliert, daß die lokalen Strukturmerkmale beseitigt sind. Dieses manipulierte Phasendifferenzbild wird vom ursprünglichen Phasendifferenzbild subtrahiert, so daß im Ergebnis ein Phasendifferenzbild entsteht, welches nur noch die lokalen Verformungen aufweist.

In dem resultierenden Phasendifferenzbild ist es nun sehr viel leichter möglich, Strukturmerkmale, insbesondere Strukturdefekte, zu erkennen, da die störende Überlagerung von globalen Verformungen beseitigt ist.



DE 199 06 681 A 1

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ermittlung von Strukturmerkmalen, insbesondere Strukturdefekten, an Prüfbjekten mit diffus streuender Oberfläche.

Es ist bekannt, daß zur flächenhaften Bestimmung von Verschiebungen oder Dehnungen eines Prüfbjektes mit diffus streuender Oberfläche Streifenprojektionsverfahren, wie das Moiré-Verfahren, und interferometrische Verfahren, wie das ESPI-(Electronic Speckle Pattern Interferometry) oder das Shearing Verfahren eingesetzt werden können. Welches Verfahren für ein gegebenes Prüfbjekt angewendet werden kann, hängt von der gewünschten Ergebnisart und der geforderten Auflösung bzw. der Steifigkeit des Prüfbjektes im Verhältnis zur Größe der aufgetragenen Kräfte ab.

Bei den obengenannten Prüfverfahren werden bei statischer Prüfung üblicherweise zwei Zustände des Prüfbjektes verglichen, indem das Objekt in zwei unterschiedlichen Belastungszuständen aufgenommen wird und die Interferogramme der beiden Zustände subtrahiert werden. Hierdurch ergibt sich ein Differenzinterferogramm, welches je nach verwendetem Meßprinzip entweder die Verschiebung oder die Dehnung des Objektes zwischen den beiden Zuständen in Form von Interferenzlinien darstellt. Der Betrag der Verschiebung oder Dehnung an einem Bildpunkt des Differenzinterferogramms kann dann beispielsweise durch Abzählen der Interferenzlinien ausgehend von einem Bildpunkt mit bekannter Verschiebung oder Dehnung und unter Berücksichtigung der verwendeten Lichtwellenlänge bestimmt werden.

Wird der Meßkopf mit einer Phasenschiebeeinheit ausgerüstet, so kann eine erweiterte Auswertung nach dem Prinzip des Phasenshiftverfahrens durchgeführt werden (W. Osten, "Digitale Verarbeitung und Auswertung von Interferenzbildern", Kap. 6, Akademie Verlag ISBN 3-OS-501294-1). Hierbei werden Phasenbilder erzeugt, welche jedem Bildpunkt einen bestimmten Phasenwinkel zuordnen. Werden die Phasenbilder von zwei Zuständen des Objektes subtrahiert, so erhält man ein Phasendifferenzbild. Im Gegensatz zum obengenannten Differenzinterferogramm zeigt das Phasendifferenzbild nicht sinusförmig modulierte Interferenzlinien, sondern direkt den Phasendifferenzwinkel zwischen zweitem und erstem Zustand. Ein weiterer Vorteil dieser Darstellung ist ferner, daß aufgrund der beim Phasenshiftverfahren angewendeten Rechenvorschrift der Phasenwinkel normiert wird, daß heißt, der in einem Phasenbild mit einem Phasenwinkel korrespondierende Grauwert ist unabhängig von der Bildkoordinate immer konstant. Nachteil des Phasenshiftverfahrens ist, daß während des Einzugs der für das Phasenshiftverfahren erforderlichen Bildsequenz das Prüfbjekt in absoluter Ruhe verharren muß.

Zur Vermeidung dieses Nachteils, ist ein Verfahren (s. h. Patentschrift DE 38 43 396 C1) entwickelt worden, welches unter der Bezeichnung "direkte Phasenmessung" oder "räumliches Phasenshiftverfahren" bekannt ist. Dieses Verfahren benötigt nur noch eine Gitterprojektion bzw. ein Kamerabild um 2π modulierte Phasenbilder zu berechnen.

Um dem Prüfer die Auswertung von Phasendifferenzbildern zu erleichtern, ist es sinnvoll, diese hierzu so aufzubereiten, daß die Fehlstellen für den Prüfer möglichst deutlich aufscheinen. Hierzu ist es insbesondere zweckmäßig die häufig vorhandenen Ganzkörperbewegungen oder sonstige nicht relevante globale Objektverformungen, die den lokalen Verformungen überlagert sind, zu eliminieren, um das Erkennen von lokalen Strukturmerkmalen insbesondere Strukturdefekten zu erleichtern.

Die Patentschrift DE 195 01 073 A1 "Bildverarbeitungsverfahren zur Ermittlung der Strukturfestigkeit eines Prüf-

objektes mit diffus streuender Oberfläche" beschreibt ein Auswerteverfahren für Shearografie Phasenbilder, welches lokale Fehler für den Prüfer besonders deutlich sichtbar aufbereiten soll. Dabei wird das Phasendifferenzbild zunächst verstetigt, im Bildverarbeitungssystem um einen festen Betrag ΔX verschoben und nicht verschobenes und verschobenes Bild voneinander subtrahiert. Hierdurch wird im günstigsten Fall der Fehler mit der doppelten Amplitude dargestellt. Dieses Verfahren besitzt aber erhebliche Nachteile. So ist die Demodulation bzw. Verstetigung des Phasendifferenzbildes erforderlich. Bei der Demodulation wird für jeden Bildpunkt der zunächst unbekannte 2π Offset des ermittelten 2π modulierten Phasenwinkels rekonstruiert, indem die Umgebung auf gewisse Stetigkeitseigenschaften hin untersucht wird. Diese Vorgehensweise ist jedoch fehleranfällig, wobei sich ein einmal aufgetretener Demodulationsfehler bei der weiteren Demodulation in seiner Umgebung fortpflanzt. Ferner wird bei Fehlergrößen die sehr verschieden von ΔX sind, genau das Gegenteil von dem erreicht, was angestrebt ist, die Amplitudenverteilung innerhalb des Fehlers ist dann nämlich kleiner als vorher.

Ausgehend von diesem Stand der Technik ist es Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Ermittlung von Strukturmerkmalen an Prüfbjekten mit diffus streuender Oberfläche anzugeben, welches ein Ergebnisbild erzeugt, in dem die ursprünglich vorhandenen globalen Verformungen beseitigt sind und das somit dem Prüfer ein leichtes Erkennen von lokal begrenzten Strukturmerkmalen, insbesondere Strukturdefekten, im vermessenen Prüfbjekt ermöglicht.

Diese Aufgabe wird durch das in Patentanspruch 1 angegebene Verfahren gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den jeweiligen Unteransprüchen angegeben. Erfindungsgemäß wird die Objektoberfläche des zu untersuchenden Objektes mit kohärentem oder strukturiertem Licht beleuchtet und mit einer Kamera beobachtet. Die Kamera ist vorzugsweise eine CCD Video Kamera. Zur Untersuchung der Struktureigenschaften des Prüfbjektes wird dieses verschiedenen Belastungen ausgesetzt. Die durch verschiedene Belastungen hervorgerufenen Verschiebungen oder Dehnungen der Objektoberfläche werden als interferometrisch oder durch das strukturierte Licht erzeugte Intensitätsmodulation in den Abbildungen von dem zu vermessenden Objekt auf dem Bildsensor der Kamera erfaßt. Bei den Speckle-meßtechniken wird beispielsweise die Verformung der Objektoberfläche als sinusförmige Intensitätsmodulation der auf dem Bildsensor abgebildeten objektnahen Speckles registriert. Die auf dem Bildsensor der beobachtenden Kamera erzeugten Abbildungen werden zur Weiterverarbeitung einem Bildverarbeitungssystem zugeführt. Dieses ist vorzugsweise ein digitales Bildverarbeitungssystem. Aus den erzeugten und im Bildverarbeitungssystem abgelegten Abbildungen wird ein die Verschiebung oder den Spannungs-/Dehnungszustand des Objektes darstellendes Phasendifferenzbild erzeugt. Hierzu kann beispielsweise ein Phasenshiftverfahren angewendet werden.

Erfindungsgemäß wird von dem Phasendifferenzbild eine Kopie erzeugt, die gegenüber dem ursprünglichen Phasendifferenzbild so manipuliert wird, daß die Strukturmerkmale beseitigt oder zumindest stark unterdrückt sind, und anschließend die manipulierte Kopie des Phasendifferenzbildes mit dem ursprünglichen Phasendifferenzbild verknüpft. Es entsteht durch Verwendung einer geeigneten Verknüpfung, vorzugsweise der Subtraktion der manipulierten Kopie des Phasendifferenzbildes vom ursprünglichen Phasendifferenzbild, ein resultierendes Phasendifferenzbild, bei dem globale Verformungen, Ganzkörperbewegungen oder Setzvorgänge eliminiert sind, wohingegen die im manipulierten Phasendifferenzbild eliminierten Strukturmerkmale

im resultierenden Phasendifferenzbild ganz oder nahezu unverändert weiterbestehen.

Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung wird zur Beseitigung der Strukturmerkmale im manipulierten Phasendifferenzbild ein Tiefpaßfilter angewendet, da sich typischerweise signifikante Strukturmerkmale insbesondere Strukturdefekte als lokale Extremwerte mit geringer flächiger Ausdehnung im Phasendifferenzbild zeigen. Zur Manipulation des Phasenbildes mittels eines Tiefpaßfilters wird dieses vorteilhafterweise zuvor in ein Sinus- und ein Cosinusbild zerlegt. Hierzu wird punktweise vom Phasenwert der Sinus- bzw. Cosinuswert berechnet und in einem Sinus- bzw. Cosinusbild abgelegt. Durch diese Transformationen erhält man aus dem Phasenbild zwei sinusförmig modulierte Streifenbilder, die im Gegensatz zum Phasenbild keine Unstetigkeitsstellen in Form von Phasensprüngen aufweisen und somit für eine Tiefpaßfilterung geeignet sind. Nach der Tiefpaßfilterung kann sodann aus dem Sinus- und dem Cosinusbild unter Verwendung der Arcustangens Funktion erneut das Phasenbild berechnet werden.

Um die Strukturmerkmale im manipulierten Phasendifferenzbild zu eliminieren muß der Tiefpaß so stark gewählt werden, daß die größten zu erwartenden Merkmale noch weitestgehend beseitigt werden. Wird gemäß einer Ausführungsform der Erfindung eine Filtermatrix verwendet, so wird die Filtermatrix in etwa so groß wie das größte erwartete Strukturmerkmal gewählt. Bei einer üblichen Kameraauflösung, beispielsweise gemäß der CCIR Norm mit 768×576 Pixels, und einer maximalen Strukturmerkmalsgröße von 10% der Bildgröße beträgt die Größe der Filtermatrix somit etwa 76×76 . Die Filterung mit einer solch großen Filtermatrix benötigt auch auf aktuellen Rechnersystemen erhebliche Zeit zumal die Filterung sowohl auf dem Sinus- als auch auf dem Cosinusbild durchgeführt wird. Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung kann alternativ ein rekursives Tiefpaßfilter angewendet werden. Dieses Filter besitzt den Vorteil, daß unabhängig von der gewählten Filterstärke der gefilterte Wert eines Bildpunktes jeweils nur aus dem in Filterrichtung in der Vorgängerspalte und der Vorgängerzeile befindlichen Bildpunkt errechnet wird. Im Gegensatz zu den meisten anderen Filtern wird beim rekursiven Tiefpaß der gefilterte Wert ins Bild zurückgeschrieben und für den nächsten zu filternden Bildpunkt weiterverwendet (daher Bezeichnung "rekursiv"). Die Verknüpfung mit dem Bildpunkt der Vorgängerspalte bzw. der Vorgängerzeile erfolgt gemäß den folgenden Formeln:

Verknüpfung mit Vorgängerspalte:

$$I'(x,y) = (1 - k) \times I(x - 1, y) + k \times I(x, y).$$

Verknüpfung mit Vorgängerzeile:

$$I'(x,y) = (1 - k) \times I(x, y - 1) + k \times I(x, y).$$

Mit:

x: Spaltenkoordinate des Bildpunktes

y: Zeilenkoordinate des Bildpunktes

$I(x,y)$: ursprünglicher Intensitätswert am Bildpunkt (x,y)

$I'(x,y)$: gefilterter Intensitätswert am Bildpunkt (x,y)

$I(x-1,y)$: Intensitätswert des Bildpunktes in der in Filterrichtung vorhergehenden Spalte

$I(x,y-1)$: Intensitätswert des Bildpunktes in der in Filterrichtung vorhergehenden Zeile

k: Filterstärke (reelle Zahl im Intervall $]0 \dots 1[$).

Wird der rekursive Tiefpaßfilter sehr stark eingestellt (d. h. k nahe 0), so wird das Bild zunehmend verfälscht, d. h. neben der erwünschten Tiefpaßwirkung wird das Bild auch geometrisch verzerrt. Um diese Effekte zu minimieren, wird

gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform dieses Filterverfahrens das Filter mit einer geringeren Stärke (d. h. größerem k) mehrmals angewendet und dabei die Filterung von unterschiedlichen Eckpunkten des zu filternden Bildes aus gestartet, damit sich die geometrischen Verzerrungen weitestgehend gegenseitig kompensieren.

Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand von Zeichnungen erläutert.

In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine typische Prüfvorrichtung zur Ermittlung von Strukturdefekten mittels des Shearing Verfahrens;

Fig. 2 die Verfahrensschritte anhand von Schnitlinienbildern;

Fig. 3 ein mittels der in **Fig. 1** gezeigten Prüfvorrichtung erzeugtes Phasendifferenzbild das lokale Strukturdefekte zeigt, denen eine globale Verformung überlagert ist;

Fig. 4 das in **Fig. 3** gezeigte Phasendifferenzbild, das einer starken rekursiven Tiefpaßfilterung unterworfen wurde, um die lokalen Strukturdefekte zu beseitigen.

Fig. 5 das in **Fig. 3** gezeigte Phasendifferenzbild von dem das in **Fig. 4** gezeigte gefilterte Phasendifferenzbild subtrahiert wurde.

Fig. 6 das in **Fig. 5** gezeigte Phasendifferenzbild nach der Verschiebung der Nullwinkellage auf einen mittleren Grauwert.

Die **Fig. 1** zeigt eine Versuchsanordnung zur Prüfung eines Bauteils 3 mittels Shearografie. Das Bauteil 3 wird durch Unterdruck geprüft, wobei eine Zustandsänderung des Bauteils 3 durch eine Druckänderung erfolgt. Hierzu befindet sich das Bauteil 3 zusammen mit dem Shearografie Meßkopf 4 in einer Unterdruckkammer 1 die über den Stützen 2 evakuiert werden kann. Das Bauteil 3 wird mittels der Lichtquellen 5 und 6 mit kohärentem Licht beleuchtet. Das vom Bauteil 3 diffus zurückgestreute Licht wird in einem Michelson Interferometer 7 in zwei Teilstrahlungen aufgeteilt. Die beiden Spiegel 8 und 10 des Michelson Interferometers 7 sind so angeordnet, daß auf dem Bildsensor der Kamera 12 zwei gegeneinander versetzte Abbildungen des Bauteils 3 entstehen (Shearing Effekt). Der Spiegel 8 ist auf einem Piezo-Stellglied 9 befestigt, so daß ein Phasenshiftverfahren durchgeführt werden kann. Die Kamera 12 ist mit dem Bildverarbeitungssystem 15 bestehend aus einem Rechner mit Bildeinzugskarte 13 und einem Monitor 14 verbunden. Das Bildverarbeitungssystem übernimmt ferner die Ansteuerung des Piezo-Stellgliedes 9.

Die **Fig. 2** zeigt schematisch die einzelnen Verfahrensschritte anhand von Schnitlinienbildern bei denen die Intensität bzw. der Phasendifferenzwinkel über der Pixelkoordinate aufgetragen ist. Alle drei Schnitlinien laufen entlang denselben Bildkoordinaten und sind 2π moduliert. Schnitlinie A zeigt einen Schnitt durch das unbearbeitete Phasendifferenzbild, welches mittels des Shearing Interferometers 7 erzeugt wurde. Es sind zwei lokale Strukturmerkmale D1 und D2 zu erkennen. Die Schnitlinie A weist ferner eine globale Verformung auf. Schnitlinie B zeigt einen Schnitt nachdem das Phasenbild tiefpaßgefiltert worden ist. Die lokalen Strukturmerkmale D1 und D2 sind durch die Tiefpaßfilterung beseitigt, es verbleibt die globale Verformung. Schnitlinie C schließlich zeigt eine Schnitlinie durch das resultierende Phasendifferenzbild, das durch Subtraktion des gefilterten Phasendifferenzbildes vom ursprünglichen Phasendifferenzbild erzeugt worden ist. Ferner ist der Nullpunkt durch Addition eines konstanten Grauwerts auf einen mittleren Grauwert verschoben, so daß das statt dem Intervall 0 bis 2π das Intervall von $-\pi$ bis π mit kontinuierlich ansteigenden Grauwerten dargestellt wird.

Die **Fig. 3** zeigt ein Phasendifferenzbild des Bauteils 3, wobei das Bauteil zu zwei unterschiedlichen Druckstufen

aufgenommen wurde. Im oberen und unteren Bereich des Phasendifferenzbildes zeigen sich Strukturdefekte in Form von im Bauteil eingeschlossenen Materialtrennungen, welche durch den Unterdruck zu Ausbeulungen führen. Diesen Strukturfehlern überlagert ist eine globale Verwölbung des Bauteils, die durch einen Setzvorgang aufgrund der Druckänderung hervorgerufen wird. Diese globale Verformung erschwert das Erkennen der Strukturdefekte und insbesondere eine automatische Fehlererkennung z. B. mittels Schwellwertoperationen.

Die Fig. 4 zeigt das Phasendifferenzbild aus Fig. 3, das mittels einer starken rekursiven Tiefpaßfilterung manipuliert wurde. Durch die starke Filterung sind die lokalen Strukturdefekte des ursprünglichen Phasendifferenzbildes aus Fig. 3 nicht mehr zu erkennen.

Fig. 5 zeigt das Differenzbild zwischen dem Phasendifferenzbild aus Fig. 3 und dem tiefpaßgefilterten Phasendifferenzbild aus Fig. 4. Hierzu wurden punktweise die Grauwerte des gefilterten Phasenbildes von denen des ursprünglichen Phasenbildes subtrahiert. Es ist deutlich zu erkennen, daß die im ursprünglichen Phasendifferenzbild sichtbare globale Verformung eliminiert ist, da außerhalb der Strukturdefekte nur noch geringe Schwankungen um die Nullwinkellage zu sehen sind. Kleine positive Abweichungen von Null werden dabei mit sehr dunklen, kleine negative Abweichungen von Null mit sehr hellen Grautönen dargestellt.

Fig. 6 zeigt das resultierende Phasendifferenzbild aus Fig. 5, wobei jedoch die Nullwinkellage auf den Mittelwert zwischen hellstem und dunkelstem darstellbarem Grauwert verschoben wurde, so daß die Flächen außerhalb der Strukturdefekte mit gleichmäßigen mittleren Grauwerten dargestellt werden. Diese Nullpunktverschiebung hat zwar keinerlei Bedeutung für die Ergebniswerte bzw. Phasendifferenzen, verbessert aber den visuellen Eindruck ganz erheblich. Alle Strukturdefekte sind jetzt einwandfrei erkennbar.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Ermittlung von Strukturmerkmalen an Prüfobjekten mit diffus streuender Oberfläche, bei dem

- die Objektoberfläche mit kohärentem oder strukturiertem Licht beleuchtet wird,
- das Prüfobjekt mit einer Kamera beobachtet wird,
- das Prüfobjekt verschiedenen Belastungen ausgesetzt wird,
- die durch verschiedene Belastungen hervorgerufenen Verschiebungen oder Dehnungen der Objektoberfläche als interferometrisch oder durch das strukturierte Licht erzeugte Intensitätsmodulation in den Abbildungen von dem zu vermessenden Objekt auf dem Bildsensor der Kamera erfaßt werden,
- die auf dem Bildsensor erzeugten Abbildungen zur Weiterverarbeitung einem Bildverarbeitungssystem zugeführt werden
- aus den erzeugten Abbildungen vom Bildverarbeitungssystem ein die Verschiebung oder den Spannungs-/ Dehnungszustand des Objektes darstellendes Phasendifferenzbild erzeugt wird,

dadurch gekennzeichnet,

daß von dem Phasendifferenzbild eine Kopie erzeugt wird, die gegenüber dem ursprünglichen Phasendifferenzbild so manipuliert wird, daß die Strukturmerkmale beseitigt oder zumindest unterdrückt werden, die manipulierte Kopie des Phasendifferenzbildes mit dem

ursprünglichen Phasendifferenzbild verknüpft wird und aus dieser Verknüpfung ein resultierendes Phasendifferenzbild entsteht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Verknüpfung der manipulierten Kopie des Phasendifferenzbildes mit dem ursprünglichen Phasendifferenzbild durch die Subtraktion der manipulierten Kopie des Phasendifferenzbildes vom ursprünglichen Phasendifferenzbild erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Strukturmerkmale im zu manipulierenden Phasendifferenzbild durch eine Tiefpaßfilterung beseitigt werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß zur Tiefpaßfilterung des Phasendifferenzbildes vom Phasendifferenzbild das Sinus- und Cosinusbild berechnet wird, das Sinus- und Cosinusbild jeweils tiefpaßgefiltert wird, und aus dem gefilterten Sinus- und Cosinusbild wiederum das Phasendifferenzbild berechnet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß zur Tiefpaßfilterung eine Filtermatrix verwendet wird, deren Größe so gewählt wird, daß das größte zu erwartende Strukturmerkmal ausreichend unterdrückt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß zur Tiefpaßfilterung ein rekursiver Tiefpaßfilter verwendet wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der rekursive Tiefpaßfilter mehrmals und ausgehend von unterschiedlichen Eckpunkten der zu filternden Bilder angewendet wird.

8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß zur Manipulation bzw. Tiefpaßfilterung des Phasendifferenzbildes eine Fourier Transformation des zu manipulierenden Phasendifferenzbildes oder der daraus entwickelten Sinus- und Cosinusbilder vorgenommen wird, und die Manipulation bzw. Tiefpaßfilterung im Fourier Spektrum erfolgt.

9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das resultierende Phasendifferenzbild in einem zusätzlichen Auswerteschritt verstetigt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß im resultierenden Phasendifferenzbild die Nullwinkellage der Phasendifferenzen auf einen mittleren Grauwert verschoben wird und geringe Schwankungen um diese Nullpunktslage mit kontinuierlich ansteigenden oder absteigenden Grauwerten dargestellt werden.

11. Verfahren nach Anspruch 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die im resultierenden Phasendifferenzbild vorliegenden Grauwerte farbig dargestellt werden.

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen

Fig. 1

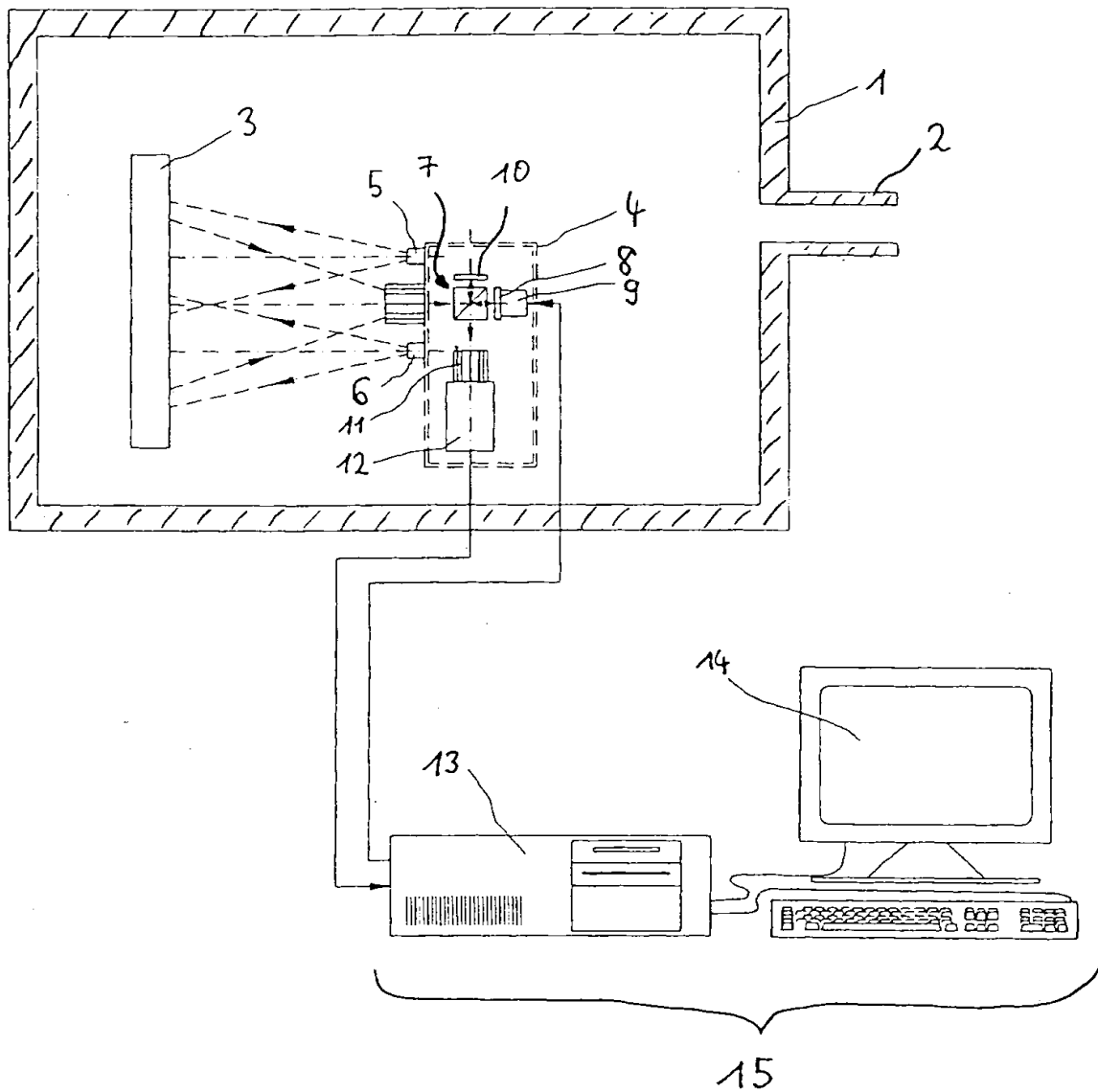


Fig. 2

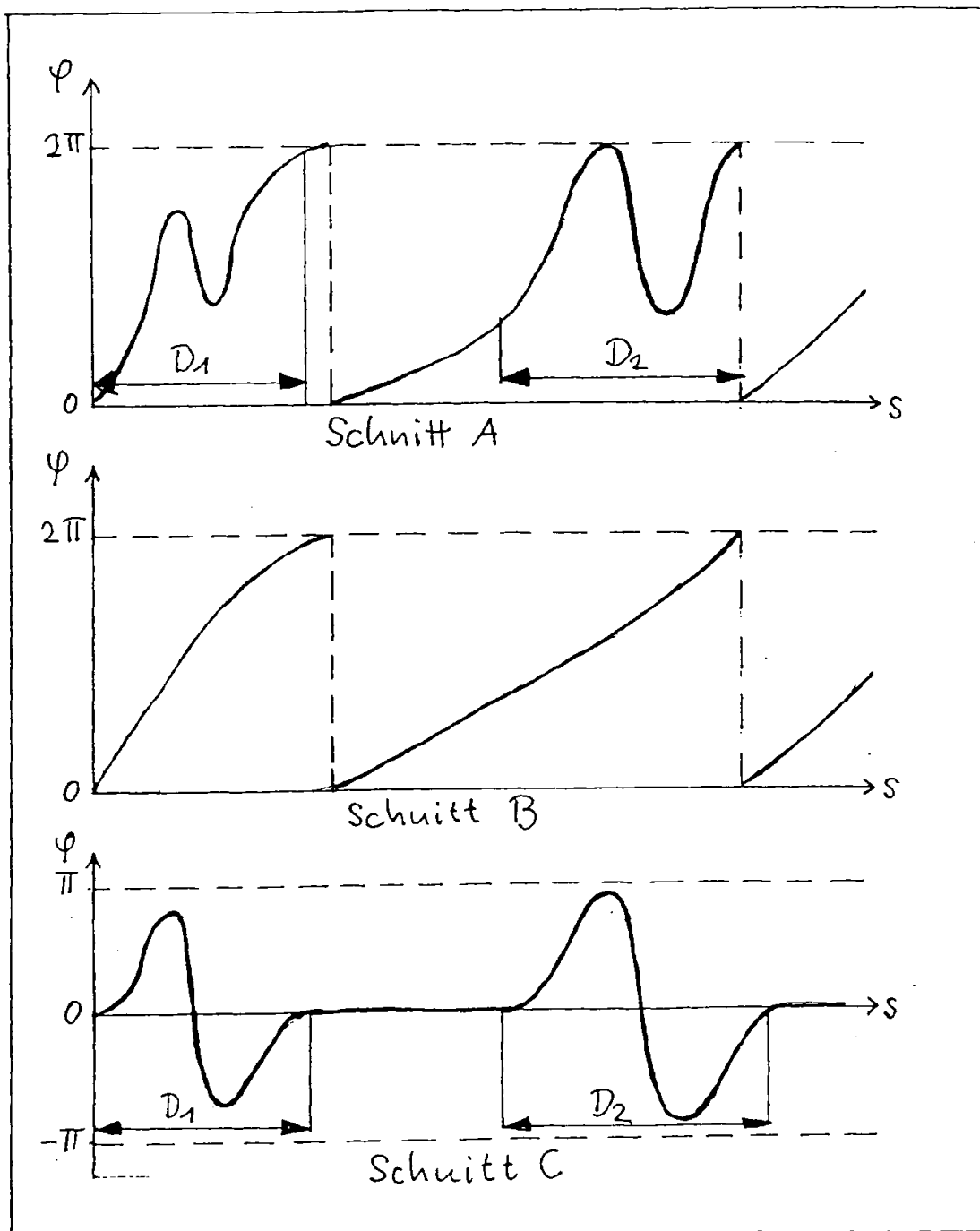


Fig. 3

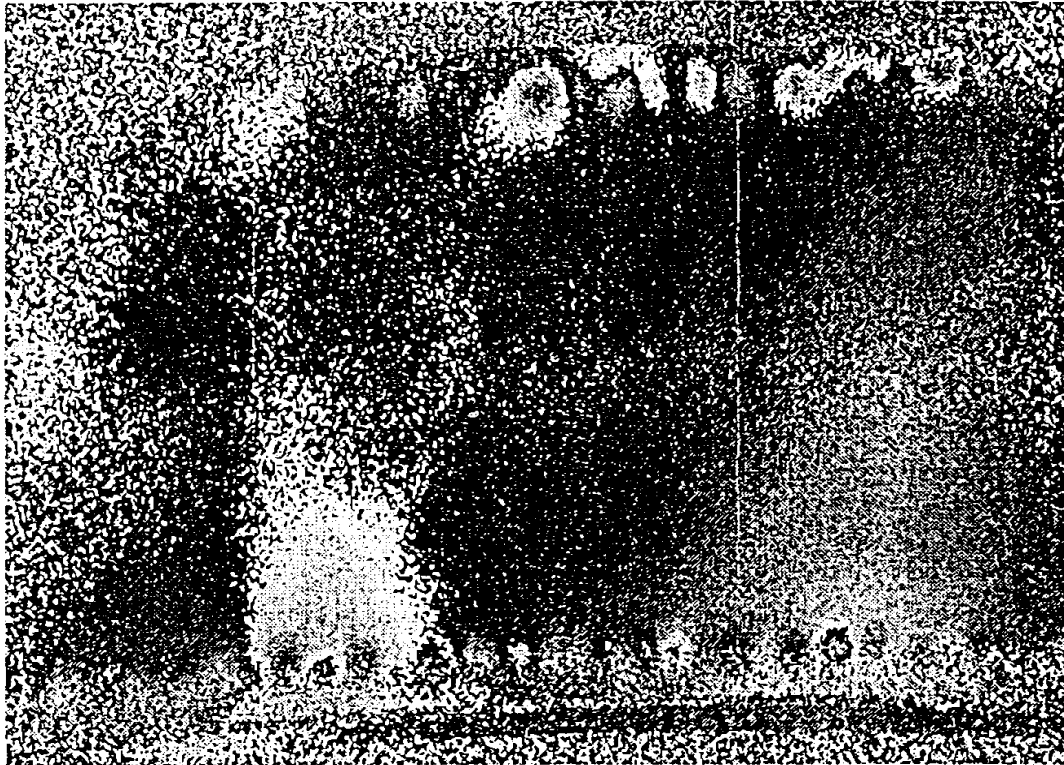


Fig. 4

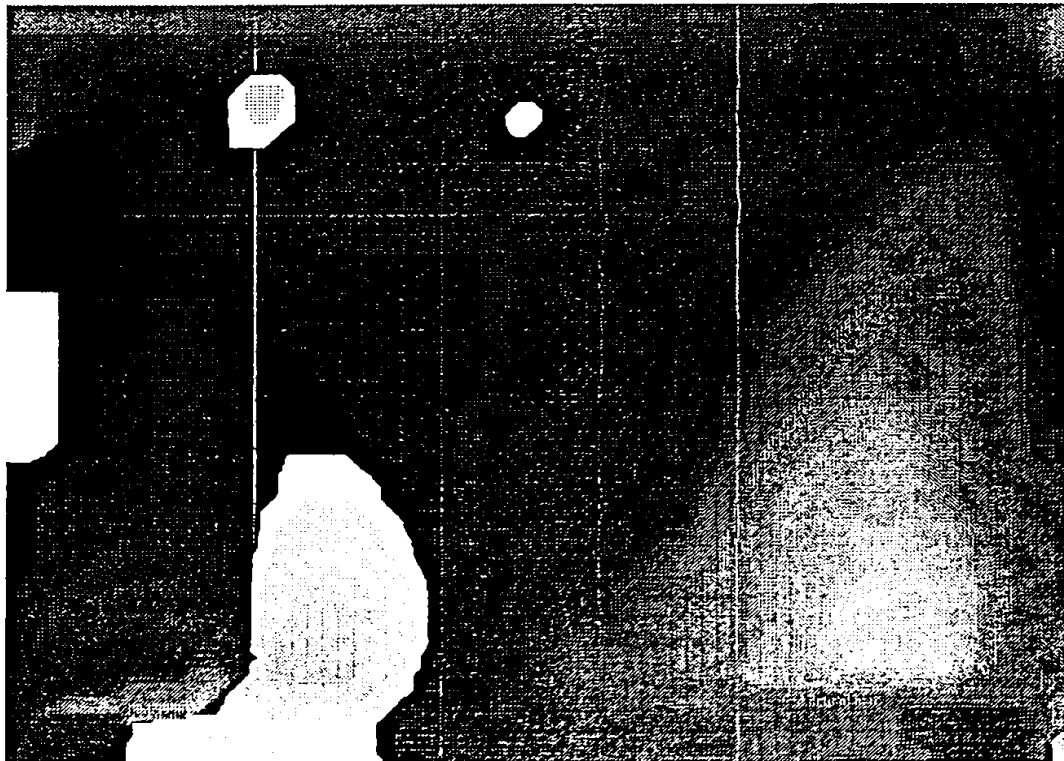


Fig. 5

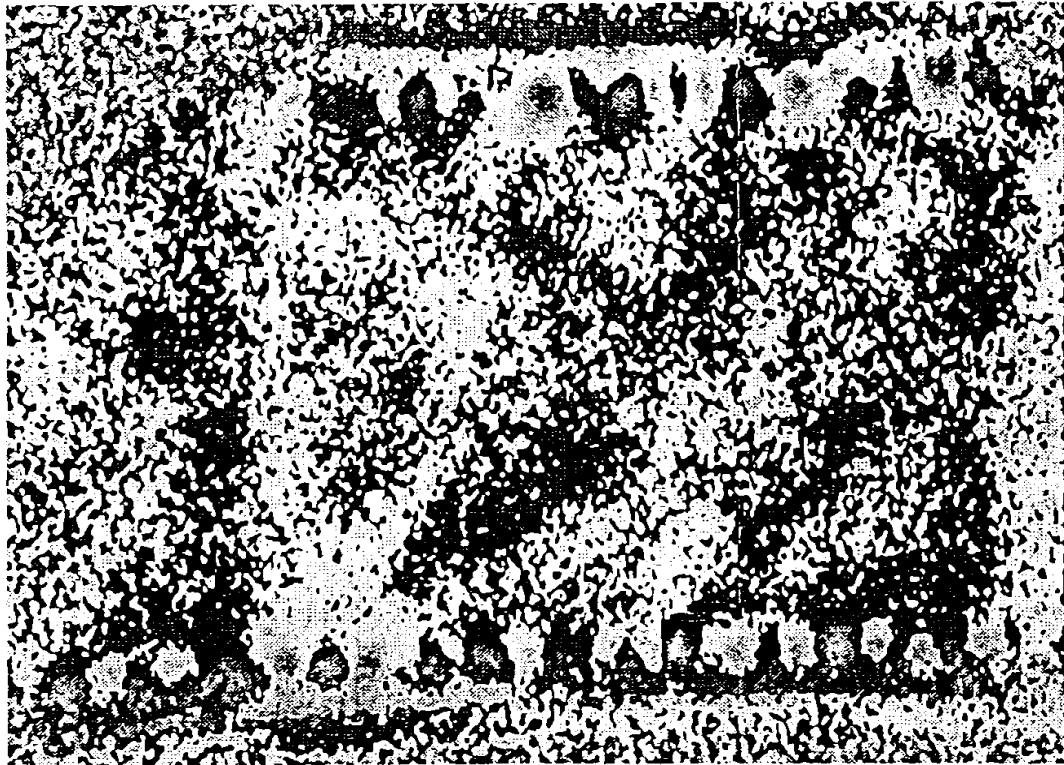


Fig. 6

